

L21シリーズ

高純度半導体製造プロセス用
精密圧力調整器

L21シリーズ

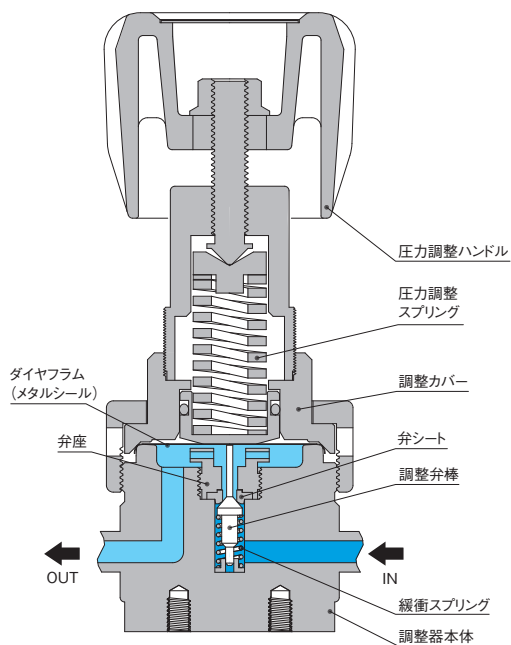
RoHS指令対応製品

高圧標準流量タイプ



入口圧力	14.8MPa以下
調整圧力	Max.0.99MPa (レンジ仕様:0~0.2,0~0.4,0~0.6,0~0.99MPa)
元圧変動	入口圧力:0.1MPa当り調整圧力変化量0.0005MPa以下
耐圧圧力	31.5MPa(入口側)、1.5MPa(調整側)
Cv値	0.09
使用温度	-10℃~+40℃
外部リーク	1×10^{-11} Pa·m ³ /s·He(真空法)
内部容積	4.75cm ³ (圧力計、継手部を除く)
質量	約1.4kg
取付方法	背面ビスによる取り付け

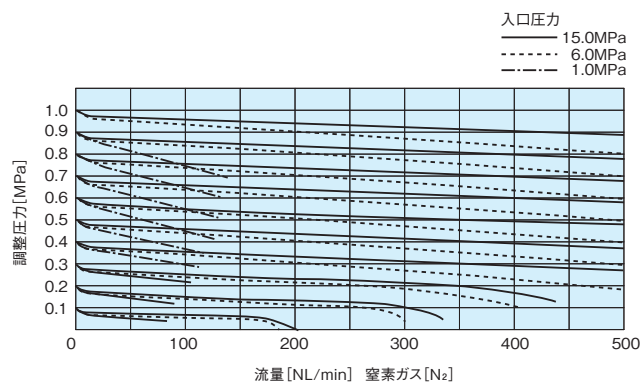
構造図



[備考]

- 圧力調整ハンドルは、必要以上に押し込まないように、ご注意ください。
- 塩素 (Cl₂) ガス、亜酸化窒素 (N₂O) ガスにご使用される場合は、L25シリーズを選定願います。
- 本製品には、フィルターが内蔵されておりません。

流量曲線図



[備考]

- 各流量曲線データは、標準仕様での参考値です。また、ガス温度等により変動します。

